



米国LECO社は安全・迅速・経済性・使い易さを常に追求し装置の開発に努めています。

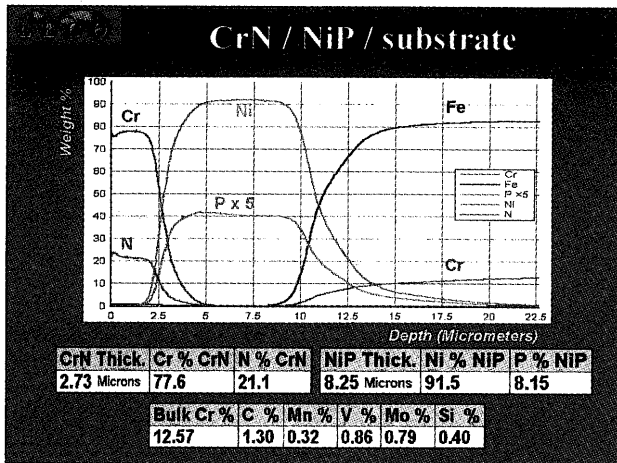
GDS-850A型 グロー放電発光分光分析装置

毎分0.5 μ mから30 μ mのスputタリング速度により深さ方向の定性・定量を僅か数分で解析します。異材の発見、品質の向上にお役立て下さい。



GDS-850A型

分析例：



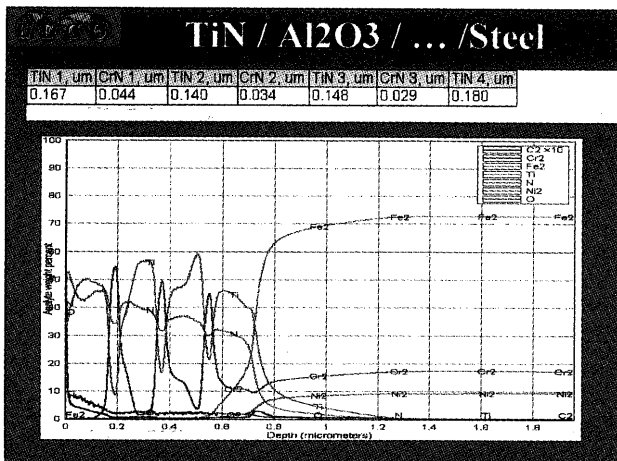
例1. 窒化クロム／ニッケルリン酸
(膜厚と化学量の測定)

仕様：

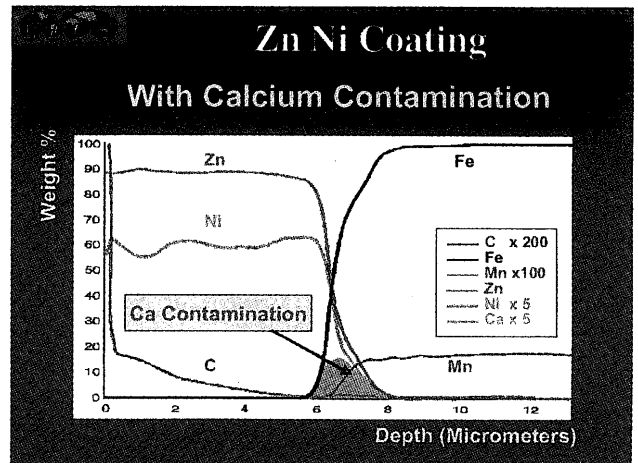
- 光学系：焦点距離0.75m
- 回折格子：2400本/mm (3600本、1800本はオプション)
- 波長範囲：120~800nm
- チャンネル数：最大58ch
- 励起源：DC電源
RF(オプション)
- アノード径：4mm…DC
(2mm、7mmはオプション)
2mm、4mm…RF

応用例：

- 鍍金 (Sn、Cr、Cd、Ni、Cu等)
- 熱化学処理 (浸炭、窒化、浸炭窒化等)
- PVD/CVD
- クラッド(アルミ)
- 酸化層
- 有機塗装膜
- 半導体
- ガラス/セラミックス



例2. 窒化チタン／アルミナ膜
(膜厚の測定)



例3. 亜鉛／ニッケル膜
(Caの汚染がみられる)



日本総代理店
LECO CORPORATION
U.S.A.

日本アナリスト株式会社



ISO-9001
No. FM 24045
(BSI - British Standards Institute)

本社 千141-0031 東京都品川区西五反田3-9-23 ☎(03)3493-7281代 FAX(03)5496-7935
大阪支店 〒560-0023 大阪府豊中市岡上の町2-6-7 ☎(06)6849-7466 FAX(06)6842-2260
九州営業所 〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2-1(北九州テクセンター) ☎(093)884-0309 FAX(093)873-1190